

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2008年12月11日 (11.12.2008)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2008/149650 A1

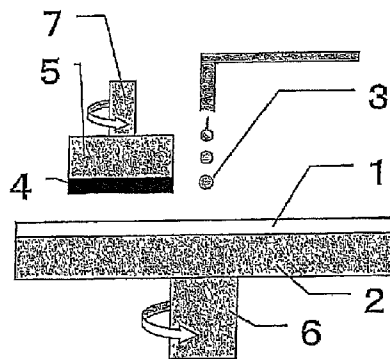
- (51) 国際特許分類: **B24B 37/00** (2006.01) **H01L 21/304** (2006.01) [JP/JP]; 〒5508661 大阪府大阪市西区江戸堀 1 丁目 1 7 番 1 8 号 Osaka (JP).
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2008/058911 (72) 発明者; および
(75) 発明者/出願人(米国についてのみ): 佐藤 彰則 (SATO, Akinori) [JP/JP]; 〒5508661 大阪府大阪市西区江戸堀 1 丁目 1 7 番 1 8 号 東洋ゴム工業株式会社内 Osaka (JP). 廣瀬 純司 (HIROSE, Junji) [JP/JP]; 〒5508661 大阪府大阪市西区江戸堀 1 丁目 1 7 番 1 8 号 東洋ゴム工業株式会社内 Osaka (JP). 中村 賢治 (NAKAMURA, Kenji) [JP/JP]; 〒5508661 大阪府大阪市西区江戸堀 1 丁目 1 7 番 1 8 号 東洋ゴム工業株式会社内 Osaka (JP). 福田 武司 (FUKUDA, Takeshi) [JP/JP]; 〒5508661 大阪府大阪市西区江戸堀 1 丁目 1 7 番 1 8 号 東洋ゴム工業株式会社内 Osaka (JP). 堂浦 真人 (DOURA, Masato) [JP/JP]; 〒5508661 大阪府大阪市西区江戸堀
- (22) 国際出願日: 2008年5月15日 (15.05.2008)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願2007-145583 2007年5月31日 (31.05.2007) JP
- (71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): 東洋ゴム工業株式会社 (TOYO TIRE & RUBBER CO.,LTD.)

[続葉有]

(54) Title: PROCESS FOR MANUFACTURING POLISHING PAD

(54) 発明の名称: 研磨パッドの製造方法

[図1]



(57) Abstract: A process for manufacturing a polishing pad excelling in optical detection precision while attaining prevention of slurry leakage from interspaces between polishing area and light transmission area. The process for manufacturing a polishing pad comprises the steps of preparing a urethane composition with dispersed foam according to a mechanical foaming method; while feeding out a face material or moving a belt conveyor, disposing a light transmission area on the face material or belt conveyor at a given location; continuously discharging the urethane composition with dispersed foam onto the section of the face material or belt conveyor not provided with the light transmission area; superimposing another face material or belt conveyor on the discharged urethane composition with dispersed foam; hardening the urethane composition with dispersed foam so as to form a polishing area of polyurethane foam thereby obtaining a polishing sheet, while conducting a thickness regulation into uniformity; coating one surface of the polishing sheet with a polyurethane resin coating material containing an aliphatic and/or alicyclic polyisocyanate and hardening the same to thereby provide a water impermeable film; and cutting the polishing sheet.

(57) 要約: 研磨領域と光透過領域との間からのスラリー漏れを防止することができ、光学的検知精度に優れる研磨パッドを製造する方法を提供することを目的とする。本発明は、機械発泡法により気泡分散ウレタン組成物を調製する工程、面材を

[続葉有]

WO 2008/149650 A1